水素雰囲気異方性熱エッチング(HEATE)法で作製した InGaN/GaN 多重量子井戸ナノピラーにおける発光特性のサイズ依存性

Size-dependent optical characterization of InGaN/GaN multi quantum well based nanopillars fabricated by Hydrogen Environment Anisotropic Thermal Etching (HEATE)

上智大・理工¹, 上智大ナノテクセンター²

^o生江 祐介 ¹, 伊藤 大智 ¹, 川崎 祐生 ¹, 大江 優輝 ¹, 松岡 明裕 ¹, 森谷 祐太 ¹, 菊池 昭彦 ^{1,2} Sophia Univ.¹, Sophia Nanotechnology Research Center,² [○]Yusuke Namae¹, Daichi Ito¹, Yusei Kawasaki¹, Yuki Ooe¹, Akihiro Matsuoka¹, Yuta Moriya¹, Akihiko Kikuchi^{1,2} E-mail: kikuchi@sophia.ac.jp

はじめに: InGaN/GaN量子井戸ナノ構造は、歪緩和効 果や貫通転位隔離効果、光取出効率の向上などによる 発光特性の向上をもたらす魅力的な材料である。我々 は水素雰囲気中でのGaNの熱分解反応[1]を利用し、低 損傷極微細加工が可能な水素雰囲気異方性熱エッチン グ(HEATE)法の研究を行い、GaNのエッチング特性[2] やInGaN/GaNナノ構造LEDの作製[3]等を報告してき た。本稿では、HEATE法でInGaNディスク直径を38 から2020 nmまで系統的に変化させ作製した、 InGaN/GaNナノピラーアレイのフォトルミネッセン ス(PL)発光特性のInGaNディスク直径依存性について 報告する。

実験:(0001)面Al₂O₃基板上にMOCVD法で3周期の In_{0.16}Ga_{0.84}N(2.4 nm)/GaN(11 nm)-MQWを成長した pn接合エピウェハ表面に、厚さ10 nmのSiO₂膜を堆積 した。電子線描画とリフトオフ法によりTiナノパター ンを作製し、CF₄ガスを用いたドライエッチングでSiO₂ ナノパターンを形成した。直径を約40 nmから2 µmま で系統的に変化させたSiO₂ナノパターンをマスクとし、 この試料を石英管状炉内で水素:アンモニア(=20:1)混 合ガス雰囲気において、圧力100 Pa、温度875 ℃の条 件で60分間加熱(HEATE)してナノピラーアレイを作 製した。最後にSiO₂とTiをウェットエッチングし、この 試料を波長405 nmのレーザーで励起してPL発光特性 を評価した。

結果: Fig.1 に作製したナノピラーアレイの鳥瞰SEM 像の一例を示す。InGaNディスク直径D=38から2020 nmのナノピラーアレイが作製された。Fig. 2にナノピ ラーアレイと非エッチング領域であるメサのPLスペク トルを示す。D=38,238,2020 nmのナノピラー、およ びメサの発光ピークエネルギーはそれぞれ2.79, 2.75, 2.74、および2.74 eVであり、D=38 nmと238 nmのナ ノピラーは微細化に伴い歪緩和に起因するブルーシフ トが確認された。Fig. 3にPL発光強度のInGaNディス ク直径依存性を示す。D = 2020 nmから824 nmまでは 発光強度に大きな違いは無いが、D = 745 nmから238 nmにかけて微細化に伴い発光強度が顕著に増加した。 これはD<745 nmにおいてInGaNディスクの内部歪が 緩和された領域からの発光が支配的になったためだと 考えられる。一方、D < 238 nmでは微細化に伴い発光 強度が急激に減少した。これはInGaNディスクの体積 に対する表面積が増大し、表面非発光再結合が支配的 になったためだと考えられる。

まとめ:HEATE法で作製したInGaN/GaNナノピラー アレイにおけるPL発光特性のInGaNディスク径依存 性を38 nmから2020 nmの広範囲で系統的に評価し、微 細化に伴う発光強度の増加および減少の傾向を確認し た。発表では発光効率についても議論する予定である。

謝辞:日頃ご支援いただく上智大学岸野克巳教授、山形 大学大音隆男助教に感謝します。本研究の一部は、 JSPS科研費JP16K14260およびJP17H02747の援助を 受けた。

参考文献: [1] K. Hiramatsu et al., MRS Proc. 482, 991 (1997). [2] R. Kita, R. Hachiya, T. Mizutani, H. Furuhashi, and A. Kikuchi, Jpn. J. Appl. Phys. 54, 046501 (2015). [3] K. Ogawa, R. Hachiya, T. Mizutani, S. Ishijima, A. Kikuchi, Phys. Stat. Sol. A, 214, 1600613 (2017).



Fig.1 Bird's-eye-view SEM images of InGaN/GaN nano-pillar arrays.



Fig.2 Logarithmic PL spectra of InGaN/GaN nanopillar arrays and mesa.



Fig.3 Logarithmic PL intensity of InGaN/GaN nanopillar arrays and mesa versus InGaN disk diameter.